

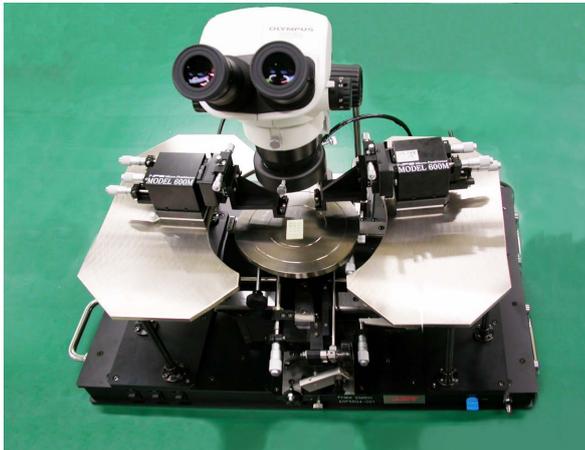
# プローブステーション ウェハー用

## 6インチのウェハーチャックを搭載 Wafer Probe Station

AGPS604-001

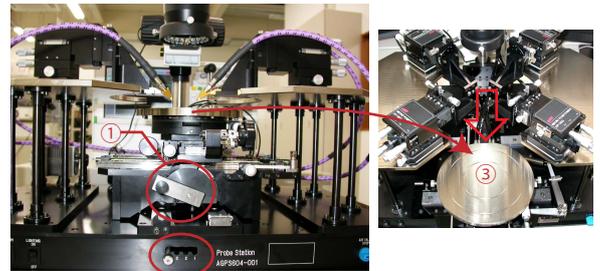


### ウェハー用プローブステーションの特長



プローブポジショナーは着磁固定されます。ウェハーテーブルはX,Y,Φ軸に対して粗動、微動で調整可能です。弊社独自の機構によりウェハーテーブルを手前前方に引き出すことができます。Z軸に上下1.5mmのポップアップ機構を持ちます。6インチ以下のウェハーに対しても真空吸着の切り替えが前面パネルで可能です。

### 弊社独自の3つの機構



①は1.5mmウェハーステージが上下するポップアップ機構です。②はウェハーチャックの真空ポイント切り替え機構です。③はウェハーチャックを前面へ引出しています。この位置にて被測定対象のウェハーを交換します。

### アプリケーション

- 6インチウェハーの測定
- ダイシング後のチップ単体測定

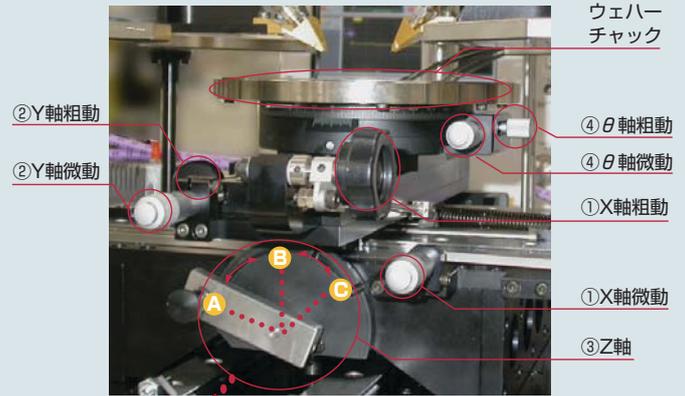
# Wafer Probe Station

AGPS604-001

最大直径150ミリのウェハも4方向からピタッと位置決め。

堅牢なボディに高性能機能を凝縮し、最高レベルの測定環境を実現。

- ① X軸ステージは、X方向に粗動ツマミで155ミリ、微動ツマミ(マイクロメーター付き)で±6.5ミリ移動します。粗動ツマミでステージを簡単に移動させ、粗動ツマミを右に回すとロックされます(X軸ブレーキ機構)。その後、マイクロメーターで微動調節します。
- ② Y軸ステージは、Y方向に移動し、仕様はX軸ステージと同様です。
- ③ Z軸ステージは、手前に90ミリ引き出せるので、測定物の設置・取り外しを迅速かつ安全に行えます。Z軸レバーをA点から右に回すと、B点でいったん止まり、チャックが8.5ミリ上昇します。プローブの位置を合わせ、レバーをC点まで回し切ると、測定物とプローブが接触します。測定を行い、レバーをB点へ戻すとチャックが1.5ミリ下降し、測定物はプローブから離れます(プローブON/OFF機構)。その後、X軸、Y軸のマイクロメーターで微調節すると、次の測定箇所へ移動できます。
- ④ θ軸ステージは、粗動ツマミで±30°、微動ツマミで±5°回転します。



プローブ

マイクロポジショナー

真空ポンプ

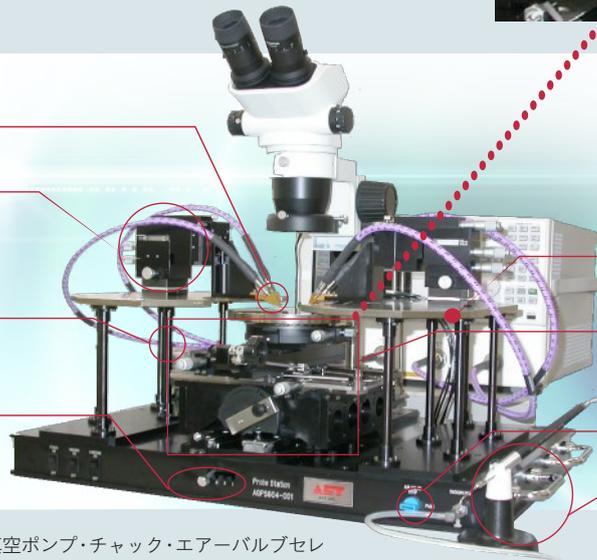
エアコントロールレバー

ポジショナーテーブル

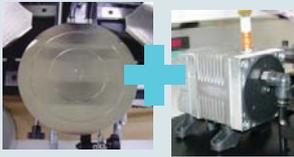
プロービングステージ

エアバルブセレクトスイッチ

真空ベン



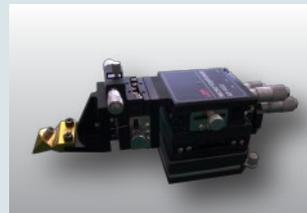
エアコントロールレバーとエアバルブセレクトスイッチ



チャック

真空ポンプ

真空ポンプ・チャック・エアバルブセレクトスイッチは、4本のチューブで接続されています。本体前面のエアバルブセレクトスイッチで、チャックと真空ベンの吸着が切換えられます。測定物の大きさにより、エアコントロールレバーでチャックの吸着力を4段階に切換えることができます。付属の真空ベンで微小なサンプルの吸引、離脱も簡単に行え、汚れの付着も防げます。



マイクロポジショナー

様々なタイプをもつマイクロポジショナーは、X-Y-Z2つのθ軸を有し、高精度な位置決めができます。プローブ固定金具は、カスタムオーダーが可能です。プローブは、エアコプレーナタイプ、セミリジッドタイプ、差動アクティブタイプから選択できます。ポジショナーテーブルは十分な面積と耐荷重を確保し、最大4台までのポジショナーを設置できます。

※ プローブおよびプローブ固定金具のカスタム作成はオプションになります。

## 仕様 型名 ACPS604-001

	周波数	プローブ仕様による
[半導体ウェハ]	ウェハー寸法	最大直径 150mm (6 inch)
[X軸-Y軸-θ軸ステージ]	X軸/Y軸ステージ (共通)	最大移動範囲: 155mm (X方向) × 155mm (Y方向) 微動範囲: ±6.5mm (最大移動範囲内での微調整) 独立したX軸/Y軸ブレーキ
	θ軸ステージ	最大粗動範囲: ±30° 微動範囲: ±5° (最大移動範囲内での微調整)
[Z軸ステージ]	Z軸ステージ	引き出し量: 90mm 移動量: 10mm プローブon/off移動量: 1.5mm
[チャック]		測定物固定方法: 真空吸着式 真空吸着切換え: 4段切換え
[マイクロポジショナー]	タイプ	ポジショナー仕様による
[プローブ]	種類	エアコプレーナ、セミリジッド、差動アクティブ
[実体顕微鏡]	オリンパス製	倍率: 0.67~4.5X ズーム比: 6.7 作動距離: 110mm 接眼レンズ: WHSZ10 x -H
[真空吸引]	真空ポンプ	到達真空度: -33.3kPa(-250mmHg) 吐出空気量: 5ℓ/min 定格電圧: AC100V 消費電力: 15/14W 電流: 0.35/0.3A 定格時間: 連続
	真空吸引ベン	パッド径: φ6mm 吸引できる重さ: 94g
[プローブステーション 本体サイズ]	寸法と重量	600mm (W) × 400mm (D) × 550mm (H) 34kg



※ 弊社はキーサイト・テクノロジー合同会社とソリューションパートナー契約を締結しています。  
ネットワーク・アナライザなどの計測器もオプションでご提供しております。

©2014 AET Inc, All rights reserved. C-HA101-004

**株式会社 エーイーティー**  
製品に関する情報はホームページからもご覧いただけます。

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-7-6 TEL: 044-980-0505  
<http://www.aetjapan.com>

世界トップレベルのハードウェアとソフトウェアの技術と新製品をご提供すると共に、システムの設計・開発および、技術サポート・トレーニングまでさまざまな業務を展開しております。